

上側のセルに法人名称、下側のセルに代表者の氏名を記入してください。
 ※法人でない個人の方は、上側のセルに氏名を記入してください。

東京都知事 殿

申請者が複数存在する場合は、申請者のうち一名を記入し押印してください。この場合は、赤点線のセルを「申請者（他の申請者は別紙申請者一覧のとおり）」をプルダウンで選択してください。

なお、「事務手続の委任」を行う場合は、代理人の住所・氏名を入力します。ここで入力した代理人が申請者も兼ねるときは「申請者兼別紙申請者一覧の者の代理人」を選択してください。また、代理人を申請者以外の者とするときは別紙申請者一覧の者の代理人」を選択してください。

申請者

住所 東京都千代田区〇〇町一丁目1番1号

氏名 株式会社 東京〇〇〇

代表取締役 〇〇〇〇



（法人にあっては名称、代表者の氏名）
 基準排出量の「決定」「変更」いずれか該当する方を、プルダウンで選択してください。

排出量算定（新規・変更）書

年度における、その他ガス削減量算定ガイドラインの排出量の「決定」を申請します。

「東京都」は記入しないでください。
 （市区町村名から記入してください）

事業所の名称	〇〇工場		
事業所の所在地	八王子市〇〇町一丁目1番1号		
指定番号	〇〇〇〇	モニタリング計画 (承認番号)	環地総第 〇〇 号
基準年度	2002 年度 ~ 2004 年度		
適用対象期間 (算定対象年度)	2025 年度 ~ 2029 年度		
削減活動の概要	廃棄物の焼却、加工工程のドライエッチングのHの利用。		
連絡先	会社名	株式会社 東京〇〇〇	
	郵便番号	100-0001	
	住所	東京都千代田区〇町一丁目×番地1号	
	所属名	総務部環境対策課	
	担当者名	大江戸 花子	
	電話番号	03-〇〇〇〇-△△△△	
	FAX番号	03-〇〇〇〇-〇〇〇〇	
メールアドレス	hanako.oedo@xxxxxx.co.jp		
備考			

東京都が通知した「その他ガス削減量モニタリング計画承認通知書(D号様式)」の承認番号を記入してください（変更を行っている場合は最新の通知書の番号を記入してくだ

※受付欄

※この欄には、何も記入しないでください。

20XX年 9月 1日

その他ガス基準排出量算定報告書の申請者一覧

(住所及び氏名の欄は、法人にあつては、法人名、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記入する。)

その他ガス基準排出量算定報告書の申請対象となる事業所

名称 : ○○工場

所在地 : 八王子市○○町一丁目1番1号

住所 都 区

氏名 ⑩

住所 都 区

氏名 ⑩

住所 都 区

氏名 ⑩

住所 都 区

氏名 ⑩

住所 都 区

氏名 ⑩

住所 都 区

氏名 ⑩

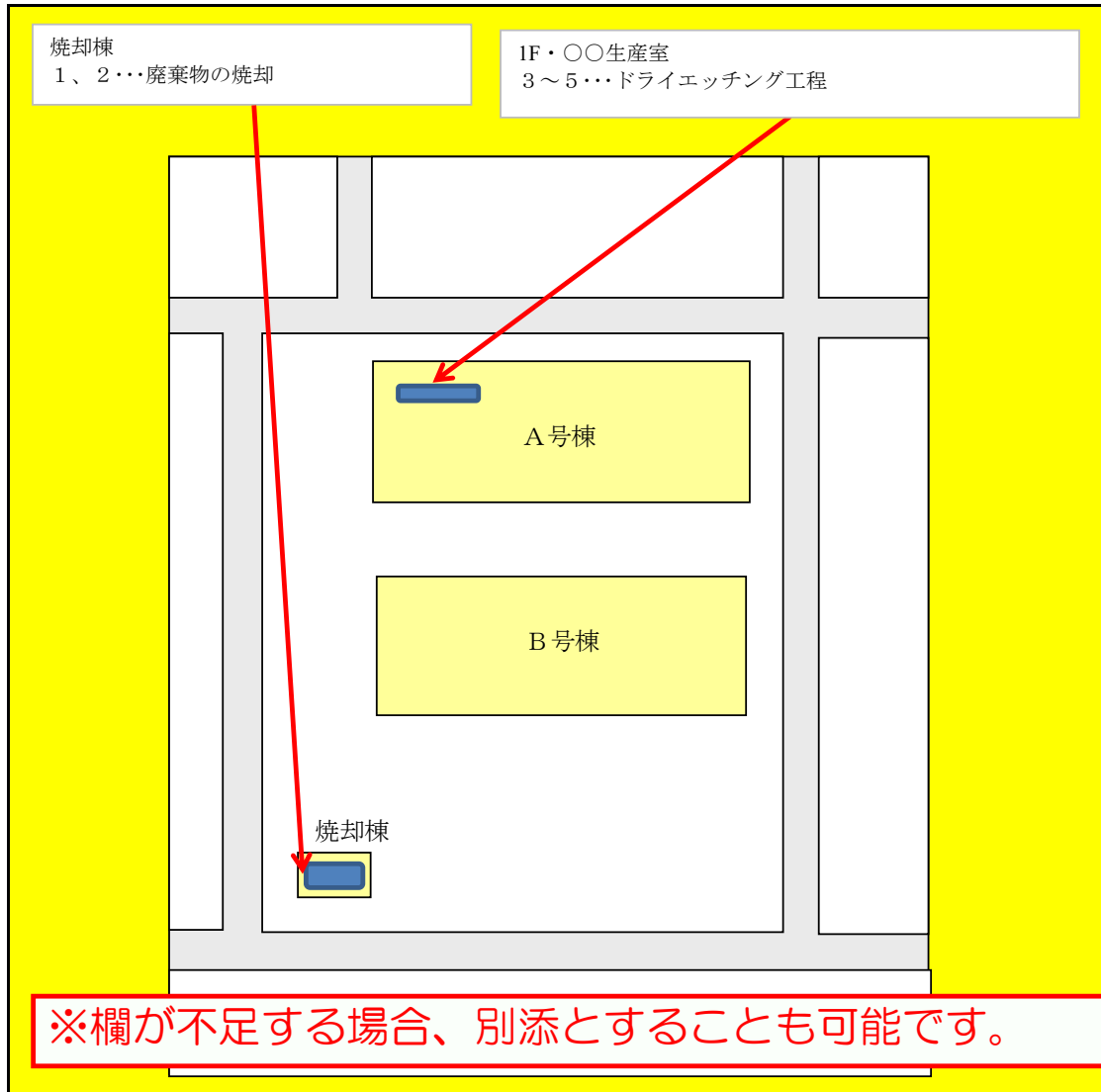
住所 都 区

氏名 ⑩

事業所名	指定番号
〇〇工場	〇〇〇〇

1 算定事業所の詳細

(1) 事業所範囲



(2) 削減対象となる事業活動及び排出活動の状況

事業活動	排出活動	番号	排出場所
半導体の製造	半導体生成時の廃棄物の焼却	1, 2	事業所内焼却炉
半導体の製造	半導体素子等の加工工程でのドライエッチング等におけるHFC、PFCの使用	3～5	A号棟(1F〇〇生産室)

このページは、基準年度当時の情報を記載してください。

--	--	--	--

事業所名	指定番号
〇〇工場	〇〇〇〇

(3) 算定体制

算定責任者	氏名	大江戸 太郎
	部署・役職	株式会社 東京〇〇〇 総務部環境課 課長
算定担当者	氏名	大江戸 花子
	部署・役職	株式会社 東京〇〇〇 総務部環境課
	電話番号	03-□□□□-△△△△
	e-mailアドレス	ooedo.hanako@△△△.co.jp
算定体制		
	<p>〇〇工場 設備管理部</p> <ul style="list-style-type: none"> ・HFC、PFC、NF3：購買伝票より使用量を把握 ・削減活動による削減量の計測データを把握 	
<p>算定責任者と算定担当者は最新の情報を記入してください。</p> <p>算定体制は、基準年度当時の情報を記載してください。</p>		

事業所名	指定番号
〇〇工場	〇〇〇〇

2 削減活動及び算定範囲の概要

(1) 削減活動の種類

番号	削減活動の内容	温室効果ガス排出量に与える影響
①	製造工程における、油の再利用による廃棄物(廃油)の削減	廃棄物の削減とともに廃棄物の焼却に伴い発生する其他ガス(非エネCO ₂)が削減される。ただし処理の一部外部委託により、事業所外でのこれらの排出が発生する。
②	半導体製造時のドライエッチングに用いるHFC-23の除害装置の設置	HFC-23が含まれる排気の燃焼除害により大気中へのHFC-23の排出量が減少する。
③	半導体プロセスに用いる新ガス(NF ₃)の使用に伴う除害装置の設置	従来用いていたPFCには除害装置を設置していなかったが、使用するガスの種類の変更に伴い除害装置を設置した。このため、新ガスが発生するものの全体的な排出量は減少する。

(2) 算定対象排出活動

< 基準年度 >

番号	排出活動	温室効果ガスの種類	当該年度との差異	差異がある場合の理由
1	廃棄物(廃油)の焼却(事業所内)	CO ₂	無	
3	半導体素子等の加工工程でのドライエッチング等におけるHFCの使用	HFC	無	
5	半導体素子等の加工工程でのドライエッチング等におけるPFCの使用	PFC	有	NF ₃ への変更により現在は存在しない

ここで入力した番号は、モニタリング計画書で割り当てた番号に合わせてください。この記入例では、モニタリング計画書の記入例の内容に合わせているため、番号が順番になっておりません。また、ここで入力した排出活動排出ごとに、様式「その5」を作成してください。

(3) 算

※施設・設備と削減活動、排出活動の実施位置の関係及び排出のプロセスがわかるように図等を用いて記載してください。なお、欄が不足する場合、別添とすることも可能です。

このページは基準年度当時の情報を記載してください。

ただし、当該年度との差異がある場合は、差異がある場合の理由欄に最新の情報を記入してください。

事業所名	指定番号
〇〇工場	〇〇〇〇

3 モニタリング方法

<基準年度>

(注) 排出活動ごとに本用紙

排出活動「番号3」の記入例のみを示しています。
※ここでは提示していない「番号1、5」の排出活動も、それぞれ同様に作成してください。

番号	排出活動	ガス種
3	半導体素子等の加工工程でのドライエッチング等におけるHFCの使用	HFC

「その4」で入力した番号ごとに、複数作成してください。

(1) 算定方法

番号	適用範囲	算定手法	算定式	有効桁数	把握するデータ項目			
					a	b	c	d
3-1	半導体製造時のドライエッチング	排出係数による計算	$a \times b - c$	2	使用量(tHFC)	排出量原単位(tHFC/tHFC)	回収・適正処理量(tHFC)	

<上記の算定方法の採用理由>

排出活動の種別から、その他ガス削減量算定ガイドラインに示す方法を採用した。

(2) データの把握方法

データ項目	測定・設定方法 (計器、証票、出典、サンプリング方法、測定頻度、測定点等)	データ記録・管理方法	有効桁数
3-1-a	使用量=購入量+期首在庫量-期末在庫量として購入量は購入伝票で、在庫量は在庫管理記録により把握する。	購入伝票は経理部門で保管し、購入量データを抽出して環境部門で記録。また在庫管理記録は購買部門で管理し、そのデータを環境部門で記録。	2
3-1-b	温対法に基づく「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」の係数を採用	算定時においては、公表している最新値を確認する。	2
3-1-c	HFCの回収・処理業者から提供を受けた回収記録から把握する。	回収記録を環境部門で保管し、電子データとして記録	2

このページは、基準年度当時の情報を記載してください。

<上記のデータ把握方法の採用理由>

使用量についてはラインへの直接投入量は連続測定していないため、購入量と在庫量から求めることとした。購入量は取引において会計データと連動しているため信頼性が高いと判断している。
排出係数は、環境省・経済産業省で公表している排出係数の最新値を採用した。
また回収・適正処理量は回収・破壊業者から回収記録の報告を受けておりこれに基づき取引を行っているため回収量として信頼性があると判断した。

